

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2008年11月21日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2008000032"/> 整理番号 <input type="text" value="11268"/> 担当者 <input type="text" value="谷中 秀臣"/>
表 題	<input type="text" value="ポリイミド薄膜のダイヤフラム製造方法"/>
技術分野	<input type="text" value="機械・加工"/>
適用製品	<input type="text" value="機械製品(マイクロマシン, MEMS)のアクチュエーターおよびセンサー"/>
目 的	<input type="text" value="マイクロマシン等でアクチュエーターとして使用するための膜厚が非常に小さいポリイミド薄膜の製造方法を提供する。"/>
技術概要	<p>マイクロマシンでは、小型でありながら大きな変位が実現できるアクチュエーターが必要とされる。ポリイミドは高分子材料でありながら機械的な性質が優れているため、厚さが十分小さな薄膜が製作できると、微小なサイズであっても大きな変位が実現できる。</p> <p>加工法として、まずポリイミドの前駆体溶液を低速および高速なスピコートによりシリコン基板の上に薄い膜状にする。</p> <p>次に、イミド化するために加熱するが、速くかつ均一に加熱するためにホットプレートを使用して3段階に加熱する。</p> <p>最後に、基板であるシリコンをポリイミド膜のない側から、ハロゲンガスを使用したICPDライエッチングにより除去し、ダイヤフラム化することができる。</p>

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp